

令和2年度 共同研究

研究参画機関:新潟県工業技術総合研究所、(株)オフダイアゴナル

スピントロニクスデバイスに活用される高品質磁性薄膜の製造技術の確立

研究概要

スピントロニクスデバイスは電子デバイスの省エネルギー化や3次元表示デバイスなどへの応用が期待されています。そのデバイスに適用する高品質な磁性ガーネット薄膜基板を製造する技術を開発します。

研究項目

- ・ 成膜工程の高清浄度化
- ・ 薄膜焼成条件の最適化
- ・ 磁気光学特性等の評価

